

リフロー炉搬送装置 MWC-0408A□RF

リフロー炉に半導体ウェーハ搬送装置（ローダ・アンローダ）、
ロット・品種管理機能をドッキング



- 12インチ以下、各ウェーハサイズに対応（FOUP、FOSB 対応などは、ご相談ください）
標準仕様：ローダ・アンローダ オープンカセット 25W×2個
- タッチパネルにより、品種登録、品種切替が可能
- クリーンロボットによるウェーハ搬送

仕様

リフロー炉搬送装置 MWC-0408A□RF (例)

項目	仕様
対象ワーク	Si ウェーハなど
ワークサイズ	12"以下 Wt=200~1000 μm ※200um 以下は、ご相談ください
カセット搭載数	標準：SEMI オープンカセット 25W×2カセット
ワークチャック方式	標準：真空下面チャック
ワーク搬送方式	標準：3軸シングルアームロボット
品種登録 / 切替	標準：30 品種 / タッチパネル
クリーン対応	クラス 10 機器構成 オプション：FFU 設置可能